

재정경제부, 관세감면대상물품 지정·고시

재정경제부는 기업의 경쟁력 향상을 지원하기 위해 시행하고 있는 관세감면제도의 적용대상품목으로 공장자동화시설재 432개 품목, 첨단산업시설재 139개 품목, 산업연구용품 253개 품목 등 모두 824개 품목을 지정·고시했다.

이에 따라 이들 품목을 수입할 때 공장자동화시설재는 중소기업 50%, 대기업 40%를 각각 감면받고 첨단산업시설재는 30%의 관세를, 산업연구용품은 관세의 80%를 감면받게 된다.

이에 광학기기 및 광산업(첨단기술)부문을 발췌해 게재하니 많은 참고 바란다.

-편집자 주-

공장자동화기기

연번	MS	부호	품명	규격
307	9006	10	인쇄용자동식판기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 금속인쇄용 원판부식장치로서 사진원판 크기가 254밀리미터(mm)×305밀리미터(mm)이상인 것에 한한다.
308	9011	10,20 80	광학현미경	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 평판디스플레이 제조공정에서 발생하는 공정별 불량원인을 분석하는 것으로서 화상으로 분석이 가능한 것 또는 최고 1천배까지 확대가 가능한 것에 한한다.
		9031 49		
309	9011	80	금속현미경 (Metallurgical Microscope)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 금속조직 관찰용으로서 최대배율 1천500배이상이고, 자동노광장치(Auto Exposure Meter)가 부착된 것에 한한다.
310	9013 9010	20,80, 10,41, 42,49	노광기 또는 정열기 (스테퍼를 포함한다)	수치제어, 프로그램 제어 또는 컴퓨터 제어방식의 것에 한한다.
317	9024	10,80	광섬유장력시험기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 최고선속 분당 300미터(m/min)이상으로 장력을 시험할 수 있는 것에 한한다.
330	9027	30, 50, 80	분광계 또는 분광광도계(플라즈마분석기를 포함한다)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 근적외선(NIR), 에프티적외선(FT-IR), 원자흡광(AAS), 원자발광(AES, OES), 플라즈마(ICP, DCP), 핵자기(NMR), 전자스핀공명(EST), 질량(Mass), 라만(Raman), 엑스레이(X-ray), 글로방전(GDS), 포토다이오드 어레이(Photodiode Array) 또는 자외선-가시광선(UV-VIS) 방식의 것 2. 플라즈마분석기의 경우는 플라즈마의 안정상태를 분석할 수 있는 것

광 학 인 포 매 이 셴

연번	MS	부호	품명	규격
				3. 3차원 영상그래픽 출력이 가능한 컴퓨터제어방식인 것 4. 빛의 파장을 통하여 색의 구성요소를 분석할 수 있는 것
331	9027	50	광섬유 모재측정기	컴퓨터제어방식의 것으로서 광섬유모재(Preform)의 광학적 또는 기하학적 특성을 측정하는 것으로서 측정정도(굴절율 오차)가 ± 002 퍼센트(%)이하 측정 광섬유모재(Preform) 직경이 80밀리미터(mm)이하인 것에 한한다.
332	9027	50, 80	광파장측정기(광섬유손실파장 측정기를 포함한다)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 최대측정 파장범위가 0.6마이크로미터(μm)이상인 것 2. 광손실 파장 또는 광파워 측정용의 것 3. 광섬유의 손실 및 기하구조를 측정하는 설비로 측정파장 범위가 800내지 1천600나노미터(nm)인 것
353	9030	39.89	광디스크검사기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 광디스크검사용으로 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 전기신호대 잡음비(Carrier to noise ratio) 분석용의 것 2. 기계특성 분석용의 것 3. 복굴절(Birefringence)분석용의 것
354	9030	39.89	광자기디스크의 도포막 특성검사기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 광디스크검사용으로 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 광자기디스크의 보자력(HC) 또는 커각도(Kerr Angle) 분석용의 것 2. 광자기디스크의 섭동막 마찰력 분석용으로 측정범위가 50밀리뉴턴(mN)이하인 것
355	9030	39.89	광디스크용 카트리지 촌범특성검사기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 광디스크검사용으로 카트리지(Cartridge)의 평탄도(Flatness) 분석용의 것에 한한다.
356	9030	40, 82, 83, 89	이동용 무선전화기 시험기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식으로 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 시디엠에이(CDMA), 지에스엠(GSM) 또는 디이시티(DECT) 방식의 휴대용단말기를 시험할 수 있는 것 2. 휴대폰(HHP), 카폰(Mobil Phone) 또는 피시에스(PCS) 시험용의 것 3. 무선전화기 송·수신 자동시험용의 것
357	9030	40, 83, 89	광전송장치 또는 광네트워크 분석기	컴퓨터제어방식의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 비동기식 전송모드(ATM) 또는 디지털 속도계위(SDH, PDH)에러측정용의 것 2. 전송속도 2기가비피에스(Gbps) 이상의 광신호 분석이 가능한 것

연번	MS	부호	품명	규격
380	3031 9027	41, 80 80	사진감광액분석기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 사진감광액의 두께 또는 성분측정이 가능한 것으로 반도체 또는 평판디스플레이 제조용의 것에 한한다.
405	9031 9013	80 20	레이저속도측정기 또는 레이저거리측정기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 레이저 빔(Laser Beam)을 사용하는 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 케이블(Cable)의 이송속도 또는 길이를 측정하는 것으로서 측정정도가 ± 0.1 퍼센트(%)이하이고 최대측정속도가 1천미터(m/min)이상의 것 2. 철판의 이송속도를 측정하는 것으로서 측정정도 ± 0.5 퍼센트(%)이하이고 최대 측정속도가 분당 800미터(m/min)이상의 것 3. 거리측정기의 경우 동시에 3차원측정이 가능하고 3개의 빔(Beam)이 서로 직각을 이루며 측정하는 것
417	9031	80	비접촉식 광학측정기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 물체의 형상을 고해상도 카메라로 입력하여 컴퓨터로 재료의 치수를 정밀 자동측정하는 설비로 정도가 ± 1 마이크로미터(μm)이하인 것에 한한다.

첨단기술산업 및 방위산업

*** 광산업**

- 가. 광정보기기(광디스크·광디스크드라이버 및 바코드리더에 한한다)제조업
- 나. 화상기록기기(캠코더 및 고속카메라에 한한다)제조업
- 다. 상재생기기(칼라복사기·인텔리전트복사기 및 현상기에 한한다)제조업
- 라. 상관측기기(고분해능현미경에 한한다)제조업
- 마. 광학기기용렌즈 또는 프리즘(통일상품명 및 부호체계에 관한 국제협약 부속서의 품목번호 제 9001.90호 및 제9002호의 것에 한한다)제조업
- 바. 레이저 발전장치제조업
- 사. 광섬유 및 광케이블제조업

광학인포메이션

연번	MS	부호	품명	규격	비고
40	9011 9012 9022 9027	10,20, 80 10 19 80	특수현미경	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 최대배율 10만배이상의 것 2. 음향, 레이저, 엑스선, 이온, 적외선, 형광, 편광, 광자(Photon) 또는 광섬유를 이용하는 것 3. 반도체 소자 또는 액정표시장치를 검사할 수 있도록 홀더(Holder)가 부착되어 있고, 사진을 찍을 수 있도록 고안된 것	전지제조업, 반도체제조업, 전자부품제조업, 전자부품 및 재료제조업, 인쇄회로기판제조업
68	8456	10	레이저가공기(Laser M/C)	수치제어방식의 것으로서 동시 5축 제어가 가능한 야그(YAG)형으로 드릴링·커팅 및 용접이 가능한 것에 한한다.	동력발생장치제조업
82	9012	10	실체현미경	배율이 300배이상인 것에 한한다.	절삭공구제조업
84	9026	80	3차원레이저도플러속도계	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 빔 익스펜더(Beam Expander)가 빔의 직경을 254밀리미터(mm)이상으로 확대할 수 있는 것 2. 렌즈의 포커스 거리가 800 내지 2천200밀리미터(mm)인 것	선박용극저온액화가소보전운송장치제조업
112	8419 8479	89 89	화학가스증착기	광섬유 수트(Scot) 제조용의 것으로서 최대증착속도가 분당 10그램(g/min)이상인 것에 한한다.	광섬유 및 광케이블제조업
113	8421	39	화학가스배기설비	광섬유제조중 발생하는 유독가스 처리장치로서 최대 처리유량이 분당 50세제곱미터(m ³ /min)이상인 것에 한한다.	광섬유 및 광케이블제조업
114	8477 8479	20.59 81.89	광섬유보호자켓 압출기	최대압출속도가 분당 90미터(m/min)이상이고, 최대압출량이 시간당 100킬로그램(kg/h)이상인 것에 한한다.	광섬유 및 광케이블제조업
115	8479	40, 81, 89	튜브(Tube) 집합기	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 알루미늄스페이서에 튜브외경 1밀리미터(mm)이상의 광섬유를 집합하는 것 2. 알루미늄코어(Core)홈에 루스튜브(Loose Tube) 광섬유를 집합하는 것으로서 알루미늄코어 송출, 튜브공급, 튜브삽입, 젤리충전, 권취장치가 인라인(In-Line)시스템화되어 있는 것	광섬유 및 광케이블제조업
116	8479	40, 81, 89	권선기	광섬유, 루스튜브 또는 광케이블을 분당 50미터(m/min)이상으로 권선할 수 있는 것에 한한다.	광섬유 및 광케이블제조업
117	8479	82	분쇄기	복사기 토너 제조용의 것으로서 입자크기를 7 내지 13마이크로미터(μm)로 분쇄할 수 있는 것으로 생산능력이 시간당 80킬로그램(kg/h)이상인 것에 한한다.	상재생기기제조업
118	8479 8514	89 10, 20, 30, 40	광섬유 인발기 또는 제조기	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 광섬유 인발시 코팅(Coating)전에 모재(Preform)를 지름 150마이크로미터(μm)이하로 인발 가능한 것	광섬유 및 광케이블제조업

광 학 인 포 메 이 션

연번	MS	부호	품명	규격	비고
				2. 모재(석영 유리봉)를 응용하여 분당 최대선속 500밀리미터(m/min)이상으로 지름 150마이크로미터(μm)이하의 코팅된 광섬유를 제조할 수 있는 것 3. 광섬유 모재를 장착·응용·인발·코팅·권취 및 외경측정 장치가 인라인(In Line) 시스템화 되어 있는 것	
119	8479	89	도포기	4헤드 코팅(Head Coating)방식으로서 지폭 500 내지 1천 750밀리미터(mm)까지 생산할 수 있고, 생산속도는 분당 80 내지 200미터(m/min)이며 생산능력이 월 175톤(t)이상인 것에 한한다.	상재생기기 제조업
120	8479	89	현상제 제조기	복사기 또는 프린터 현상제 제조용의 것으로 산화철에 수지를 코팅(Coating)하여 제조하는 것으로서 수지코팅 범위가 0.01내지 10마이크로미터(μm)이고, 일일생산능력이 1천킬로그램(kg/day)이상인 것에 한한다.	상재생기기 제조업
121	8479	89	오파시(OPC) 감광체제조기	3스텝디핑(Step Dipping)방식으로서 감광액 코팅(Coating)두께가 0.1내지 30마이크로미터(μm)이며 생산능력이 7분당 30 내지 50개인 것에 한한다.	상재생기기 제조업
122	8514	10, 20, 40	가열로	최고 가열속도가 800도($^{\circ}\text{C}$)이상인 전기식 또는 전자유도식의 것으로서 광섬유제조용의 것에 한한다.	상재생기기 제조업
123	9027	80	색분산측정기	광섬유의 색분산 특성측정용으로서 측정파장이 0.6마이크로미터(μm)이상의 것에 한한다.	광섬유 및 광케이블제조업
124	9027	80	광파장분석기	최대측정 파장범위가 0.6마이크로미터(μm)이상의 것에 한한다.	광섬유 및 광케이블제조업
125	9030	40	광섬유 기하구조 측정기	컴퓨터제어방식의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 리본광섬유의 기하구조를 측정하는 설비로 광섬유수 2심 이상의 것 2. 광섬유 특성측정용의 것으로서 코어(Core)직경이 0.1밀리미터(mm)이하이고, 클래딩(Cladding) 직경이 0.5밀리미터(mm)이하인 광섬유를 측정할 수 있는 것	광섬유 및 광케이블제조업

산업기술의 연구·개발기기

연번	MS	부호	품명	규격
25	8456 8479 9013	10, 99 20	레이저 리페어기	웨이퍼(Wafer), 전자부품 칩(Chip), 마스크(Mask) 또는 평판디스플레이(FPD)의 불량회로 수리용에 한한다.
36	8417	60	칼라 레이저 프린터 (Color Laser Printer)	레이저프린팅방식으로서 브라운관의 형광면을 칼라로 종이에 프린트하여 형광체가 판넬에 도포된 상태를 관찰할 수 있는 것에 한한다.
90	9006 8525	30, 40	카메라(고속카메라, 특수용도 카메라를 포함한다)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 적외선을 이용한 것 2. 디지털 방식으로서 촬영속도 1십만분의 1초이상의 고속촬영용의 것 3. 투과전자현미경에 사용하는 것으로서 해상도 1천280픽셀(Pixel) × 1천24픽셀(Pixel)이상의 고분해능 시시디(CCD) 카메라를 장착한 것 4. 내충격성이 50지(G) 이상이고, 초당 1천프레임(frame/s)이상의 촬영이 가능한 것 5. 카메라구동으로인한 자체 열을 냉각시키기 위한 냉각장치가 있는 것
91	9010 8479	89	현상기(현상 및 도포기를 포함한다)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 현상 및 도포겸용의 것 2. 평판디스플레이, 반도체 또는 브라운관 형광막 연구용의 것 3. 자외선 노광방식의 것 또는 현상액온도를 자동조절할 수 있는 것
92	9010 9022 9013 8456	10, 42 49 19 80, 20	정렬기 또는 노광기(스테퍼를 포함한다)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 전자부품, 반도체 또는 평판디스플레이 연구용으로서 대등, 축소 또는 확대노출방식의 것 2. 정렬기로서 레이저(Laser)용접 또는 유브이(UV)접착제를 사용하는 보딩기능을 가지고 있는 것 3. 엑스선, 자외선, 전자빔 또는 레이저 노광방식의 것
93	9011 9012 9022 9027	10, 20, 80 10 19 80	현미경	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 최대배율 10만배이상의 것 2. 음향, 레이저, 엑스(X)선, 형광 또는 편광을 이용하는 것 3. 적외선 또는 광자(Photon)를 이용하는 것 4. 이온 또는 광섬유를 이용하는 것 5. 고온관찰용으로서 최고온도가 1천600도(℃)이상의 적외선방식의 로가 부착된 것 6. 반도체 소자 연구용으로 사진촬영이 가능한 것

광 학 인 포 매 이 션

연번	MS	부호	품명	규격
				7. 시료의 표면형태 정밀분석으로 탄화물의 분포 및 특정성분의 분석이 가능한 것 8. 재료의 밀도 및 조직분포 분석이 가능한 것
94	9013 9031	20 80	디지털타이저(Digitizer)	레이저를 이용한 것으로 분해능력이 0.1밀리미터(mm)이상 또는 최대측정속도가 초당 100포인트(point/s)이상인 것에 한한다.
122	9027	50	광도 측정기	다음 각호의 1에 해당되는 것에 한한다. 1. 컴퓨터 제어방식의 것으로서 분광분포도·비색도 및 광도를 측정할 수 있는 것 2. 파장의 정도가 ±1나노미터(nm)이내 또는 파장의 재현성이 ±0.5나노미터(nm)이내인 것
123	9027	50	분광식 색차계	풀 스케일(Full Scale)에 대하여 ±0.002퍼센트(%)이내의 정밀도로 측정할 수 있는 것에 한한다.
135	9027	80, 50	광파장측정기 (흡광 또는 발광 특성분석기를 포함한다)	광학계에서 출사되는 광의 파장분포를 분석하여 광학계를 보정하기 위한 장치로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 최대측정파장 범위가 0.1마이크로미터(μm)이상인 것 2. 광손실파장 또는 광파워(Power)측정용의 것 3. 광원이 레이저인 것
151	9027	80	광섬유 기하구조 측정기	광섬유 기하구조 측정용으로서 코어(Core)직경이 0.1밀리미터(mm)이하이고, 크래딩(Cladding)직경이 0.5밀리미터(mm)이하인 것에 한한다.
155	9027	80	리본 광섬유 자동 손실 측정기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 기본광섬유 손실 특정이 가능한 것으로 연속 측정 소선수가 2개 이상의 것 2. 광섬유의 자동정렬이 가능하고 커플링 손실이 3데시벨(dB)이하인 것
160	9029 9013 9031	20 20 80	속도계 또는 유속계	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 비접촉식의 것으로 정도 ±0.5퍼센트(%)이내인 것 2. 레이저방식의 것으로서 측정정도가 ±2퍼센트(%)이내인 것 3. 자동차 차속 측정용으로서 오차가 시간당 1킬로미터(km/h)이하인 것 4. 주행속도 발전가속성, 등판능력 또는 브레이크 제동능력 측정의 것
174	9030 9031	39 80	광특성측정기	레이저 다이오드(Laser Diode)를 이용하는 것으로서 가변파장 범위가 50나노미터(nm)이상인 것에 한한다.
175	9030	39	편광손실측정기	광섬유 연구용으로서 측정파장 범위가 1마이크로미터(1μm)이상인

연번	MS	부호	품명	규격
	9030 9031	39 80	(Polarization Dependent Loss)	것에 한한다.
187	9030 9027	83, 89 50, 80	광 통신 분석기(광네트 워크분석기를 포함한 다)	컴퓨터 제어방식의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다. 1. 프레임에러(Frame Error) 또는 비트에러(Bit Error) 측정용의 것
215	9031 9027	80, 41, 80	사진감광액 분석기 (Photoresist Analyzer)	2. 광신호의 디지털 속도계위(SDH) 또는 전송모드 시험용의 것 반도체연구용으로서 사진 감광액 성분을 분석하는 것에 한한다.
216	9031	80	레이저 위치측정기	레이저빔을 사용하여 웨이퍼칩(Chip)의 회로간격을 측정할 수 있는 것으로서 측정정도가 밀리미터당 ± 0.1 마이크로미터($\mu\text{m}/\text{mm}$)이내
251	9033		광소자정렬장치	인 것에 한한다. 광섬유 연구용으로서 정렬 분해능이 0.5마이크로미터(μm)이하인

제7회 광자기술 학술회의 논문모집

제7회 광자기술 학술회의가 오는 11월 5일부터 양일간 부산 부경대학교에서 개최할 예정입니다. 이에 오는 10월 2일까지 논문을 모집중입니다.

폭넓은 광자기술에 관한 토론과 정보교환의 장을 마련하고자 열리는 이번 광자기술 학술회의는 한국통신학회 광통신연구회, 대한전자공학회 광파 및 양자전자공학연구회, 대한전기학회 광전자 및 전자파연구회 한국광학회 광자기술분과 IEEE/LEOS한국지부, 그리

고 SPIE 한국지부가 공동으로 개최한다.

〈논문모집분야〉

1. 광통신
2. 광소자
3. 광섬유/재료
4. 광신호처리

〈논문접수처〉

- 한국과학기술연구원 정보전자연구부 김선호 박사,
- 주소 : 서울시 성북구 하월곡동 39-1

- 전화번호 : 02)958-5701
- FAX : 02)958-5709
- email : shk@kistmail.kist.re.kr이나 web http://photonics98.kist.re.kr/

〈논문에 대한 문의처〉

- 홍익대학교 이종창 교수
- 전화 : 02)320-1484
- FAX : 02)320-1119
- email wave@wow.hongik.ac.kr